ФОРМИРОВАНИЕ МАГНИТНОЙ АНИЗОТРОПИИ ПЛЕНОК GaMnSb ТЕРМООБРАБОТКОЙ

А. И. Дмитриев^{а,b*}, А. В. Кочура^с, А. П. Кузъменко^с,

Л. С. Паршина^d, О. А. Новодворский^d, О. Д. Храмова^d,

Е. П. Кочура^с, А. Л. Васильев^е, Б. А. Аронзон^{е, f**}

^а Институт проблем химической физики Российской академии наук 142432, Черноголовка, Московская обл., Россия

> ^b Российский университет транспорта 127994, Москва, Россия

^с Юго-Западный государственный университет 305040, Курск, Россия

^d Институт проблем лазерных и информационных технологий Российской академии наук, филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 140700, Шатура, Московская обл., Россия

> ^е Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук 119991, Москва, Россия

> ^f Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 123182, Москва, Россия

> > Поступила в редакцию 12 апреля 2018 г.

Определены условия и механизмы контролируемого изменения магнитной анизотропии посредством термообработки пленок GaMnSb, содержащих магнитные нановключения MnSb. С помощью СКВИД-магнитометра измерены температурные и полевые зависимости магнитного момента двух групп образцов до и после отжига. Установлено, что термообработка пленок GaMnSb приводит к заметному увеличению характеристик, определяющихся магнитной анизотропией: температуры блокировки от 95 K до 390 K и поля магнитной анизотропии от 330 Э до 630 Э. Данные просвечивающей электронной микроскопии указывают на то, что изменение магнитной анизотропии пленок GaMnSb в результате термообработки может быть обусловлено переходом кристаллической структуры магнитных нановключений MnSb из гексагональной (пространственная группа $P6_3/mmc$) в кубическую (пространственная группа F-43m).

DOI: 10.1134/S0044451018090000

1. ВВЕДЕНИЕ

Одно из новых направлений спинтроники связано с созданием так называемых спиновых источников электродвижущей силы (ЭДС) или «спиновых батареек» [1]. В качестве рабочей среды спиновых аккумуляторов предлагается использовать тонкие пленки разбавленных магнитных полупроводников (РМП) (A^{III},Mn)B^V, таких как GaMnAs или GaMnSb, содержащих нановключения магнитной фазы соответственно MnAs или MnSb. ЭДС в рассматриваемых наногетероструктурах может быть индуцирована спонтанным перемагничиванием таких включений в статическом магнитном поле [1]. До недавнего времени считалось, что двухфазные системы полупроводник-ферромагнетик A^{III}B^V-MnB^V, в отличие от РМП (A^{III},Mn)B^V, менее перспективны для использования в устройствах спиновой электроники. Так, магнитные нановключения, являясь 3D-дефектом, в большинстве случаев за счет появления дополнительных источников рас-

^{*} E-mail: aid@icp.ac.ru

^{**} E-mail: aronzon@mail.ru

сеяния заряда ухудшали транспортные свойства электронной подсистемы. Само формирование включений MnB^V приводило к обеднению подсистемы диспергированных ионов Mn и, как следствие, к понижению величины косвенного обмена, поддерживающего спин-поляризованное состояние, а значит, и температуры Кюри РМП-матрицы. Кроме того, присутствие дополнительной магнитной фазы MnAs или MnSb в виде ферромагнитных или суперпарамагнитных включений затрудняло исследование магнитных свойств наногетероструктур (А^{III},Мп)В^V. Недавно было обнаружено, что в тонких пленках (А^{III},Мn)В^V поляризация дырок может быть чувствительна к намагниченности магнитных нановключений [2]. В отличие от образцов, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, где аномальный эффект Холла отрицательного знака наблюдался до температур 30 К [3–5], в образцах, выращенных методом импульсного лазерного осаждения, обнаружен положительный эффект Холла с гистерезисом вплоть до комнатных температур [2]. Аномальный эффект Холла является свидетельством спиновой поляризации носителей заряда, зависящей от намагниченности образцов. Ввиду того, что дальний магнитный порядок при комнатной температуре в образцах невозможен, авторы [2] интерпретировали наблюдаемый эффект как поляризацию носителей заряда, туннелирующих через барьер Шоттки MnSb-GaMnSb. При этом в работе [2] осталась без систематического экспериментального исследования ферромагнитная подсистема нановключений MnSb, которая и ответственна за спиновую поляризацию носителей. В работах [6,7] во многом был восполнен обозначенный пробел: определены основные магнитные характеристики (коэрцитивная сила, температура блокировки, константа магнитной анизотропии и т.д.) пленок GaMnSb, подобных исследованным в настоящей работе, исследованы микроволновое магнитосопротивление и зависимость намагниченности от концентрации носителей заряда. В работе [8] изучено спонтанное перемагничивание нановключений MnSb, внедренных в тонкие пленки GaMnSb, что приблизило понимание механизмов возникновения ЭДС в «спиновых батарейках» [1]. Наконец, в работе [9] установлена взаимосвязь между спонтанным и вынужденным перемагничиванием тонких пленок GaMnSb, содержащих нановключения MnSb.

Целью настоящей работы является определение условий и механизмов контролируемого изменения магнитой анизотропии пленок GaMnSb посредством термообработки. Для этого в работе исследовано две группы образцов — неотожженных и подвергнутых отжигу.

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Пленки GaMnSb (41 мол. % MnSb и 59 мол. % GaSb) толщиной около 100 нм и площадью около 1 см² были получены из сплава GaSb–MnSb эвтектического состава методом импульсного лазерного осаждения в условиях высокого вакуума (10⁻⁶ Topp) при температуре 100 °C. В качестве подложек использовался монокристаллический Al₂O₃. После напыления часть образцов была подвергнута отжигу при температуре 350 °C в течение 30 мин. Подробно методика изготовления и аттестации образцов описана ранее [6,7,10,11]. С помощью магнитносиловой микроскопии (сканирующий зондовый микроскоп (C3M) SmartSPM-1000, AIST-NT Inc.) было установлено, что пленки содержат ферромагнитные включения MnSb (рис. 1) с температурой Кюри выше 410 К. Большинство таких включений имеет латеральные размеры в интервале 20-150 нм. Следует отметить, что в качестве зондов использовались кантилеверы с напыленным слоем магнитного сплава Co-Cr, что позволяло обнаруживать магнитные нановключения размером до 20 нм. Структура и состав пленок контролировались сканирующим и просвечивающим электронными микроскопами (ПЭМ). Для исследования образцов с помощью ПЭМ стандартными методами были приготовлены поперечные срезы структуры пленок GaMnSb. Для этого пленочные образцы были разрезаны алмазной пилой на полоски шириной около 1 мм и склеены лицевыми сторонами пленок эпоксидной смолой. После механического утонышения до толщины 20-40 мкм с двух сторон образца в направлении параллельном поверхности следовало утонышение Ar⁺ в установке Gatan 691 PIPS (GATAN, США) при ускоряющем напряжении 5 кэВ до образования отверстия. Окончательная полировка осуществлялась ионами с понижением энергии до 0.1 кэВ. Исследование образцов проводилось в просвечивающем электронном микроскопе TITAN 80-300 (FEI, CША) с корректором сферической аберрации зонда в режимах светлого и темного поля. В последнем случае при сканировании образца использовался высокоугловой темнопольный кольцевой детектор рассеянных электронов ВУТКДРЭ (high angle annular dark field (HAADF) detector). Использование такого детектора позволяет получать изображения с контрастом, зависящим от номера элемента, или Z-контрастом.



Рис. 1. Изображения двух участков поверхности неотожженной пленки GaMnSb, полученные с помощью C3M в режимах атомно-силовой (*a*,*b*) и магнитно-силовой (*б*,*c*) микроскопии при температурах 303 K (*a*,*b*) и 413 K (*b*,*c*)

Ускоряющее напряжение составляло 300 кВ. Обработка изображений была проведена с помощью программного обеспечения Digital Micrograph (Gatan, США). Расчетная электронограмма построена с помощью программы JEMS.

Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) исследуемых пленок были измерены при комнатной температуре с помощью комбинированной системы СЗМ с конфокальным флуоресцентным спектрометром и спектрометром КРС ОmegaScopeTM (AIST-NT Inc.) с длиной волны лазерного излучения 532 нм, мощностью 50 мВт и размером пятна сфокусированного света на поверхности образца около 500 нм. Спектральное разрешение прибора 0.8 см⁻¹.

С помощью СКВИД-магнитометра (MPMS 5XL Quantum Design) были выполнены измерения температурных зависимостей магнитного момента образцов, охлажденных в нулевом магнитном поле и магнитном поле напряженностью 10 кЭ, а также петли магнитного гистерезиса в интервале температур T = 2-390 K.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Спектры КРС пленок представлены на рис. 2. Положения максимумов на них для неотожженных и отожженных пленок близки. Наиболее интенсивными являются два пика: около 150 см⁻¹ и 228 см⁻¹. Спектры КРС полупроводниковых материалов обычно содержат максимумы, соответствующие продольным (LO) и поперечным (TO) фононам. В зависимости от кристаллической ориентации поверхности пленки и геометрии проведения эксперимента некоторые из фононных мод могут не наблюдаться в спектрах КРС [12]. Для GaSb (точечная



Рис. 2. Спектры КРС при комнатной температуре неотожженных (светлые символы) и отожженных (темные символы) пленок GaMnSb

группа симметрии — T_d) LO- и TO-фононы активны вдоль кристаллографических направлений соответственно [001] и [110] [13], причем для нелегированных монокристаллов GaSb $\omega_{LO} = 236 \text{ см}^{-1}$, а $\omega_{TO} = 226$ см⁻¹ [14]. Нарушение кристаллического упорядочения приводит к изменению интенсивности и уширению фононных линий, а изменение концентрации примеси приводит к их смещению. Для *p*-GaSb повышение концентрации дырок сначала вызывает увеличение ω_{LO} (не более чем на 2 см $^{-1}$), а затем ω_{LO} уменьшается, стремясь к ω_{TO} [14]. При высоких концентрациях Mn (около 10 ат. % и выше) наблюдается уменьшение частоты ω_{LO} с увеличением содержания Mn [15], например, для Ga_{0.5}Mn_{0.5}Sb имеем $\omega_{LO} = 234$ см⁻¹ [16]. Кроме того, положение и форма пиков в спектрах КРС зависят от мощности возбуждающего излучения, которое может вызывать локальный нагрев исследуемого материала и, соответственно, сдвиг фононных мод в сторону меньших энергий. Таким образом, наблюдаемый пик около 228 см⁻¹, скорее всего, является фононной LO-модой.

Фононная мода около 150 см^{-1} была обнаружена ранее в образцах GaSb. Она является акустической и проявляется благодаря наличию колебаний вдоль связей Sb–Sb. Такие колебания становятся возможными из-за формирования а) областей у поверхности с избыточно высоким содержанием атомов сурьмы, благодаря их обратной диффузии из объема [17], б) «капель» Sb с высокой степенью кристалличности при использовании неравновесных методов модификации поверхности [18]. Хорошо заметно (рис. 2), что относительная высота этого пика уменьшается после отжига, а его полуширина уве-



Рис. 3. Температурные зависимости магнитного момента неотожженных (a) и отожженных (δ) пленок GaMnSb, охлажденных в нулевом магнитном поле — ZFC (светлые символы) и магнитном поле напряженностью 10 кЭ — FC (темные символы)

личивается, т. е. отжиг приводит к уменьшению концентрации атомов Sb, образующих связи Sb–Sb около поверхности пленки, и их дезориентации.

На рис. 3 приведены температурные зависимости магнитного момента M(T) в магнитном поле 250 Э для неотожженных (рис. 3*a*) и отожженных (рис. 3*б*) образцов, охлажденных в нулевом магнитном поле (zero-field cooled, ZFC) и магнитном поле напряженностью 10 кЭ (field cooled, FC). Температура, при которой зависимости начинают расходиться, соответствует температуре блокировки T_B нановключений MnSb. Из рис. 3 следует, что температура блокировки в неотожженных образцах составляет $T_B = 95$ K (рис. 3*a*), отжиг образцов приводит к значительному возрастанию температуры блокировки до значения $T_B = 390$ K (рис. 3*б*). Температура блокировки опре-

деляется энергией магнитной анизотропии согласно выражению $T_B = KV/25k_B$ (здесь K — константа магнитной анизотропии, V- объем нановключений, k_B — постоянная Больцмана). Остается неясным, за счет какого фактора в результате термообработки происходит увеличение Т_В более чем в четыре раза. С одной стороны, отжиг может привести к структурному фазовому переходу и, как следствие, к изменению К. С другой стороны, нельзя исключать увеличение среднего объема V нановключений, вызванное диффузионно-контролируемой агрегацией акцепторной примеси марганца в MnSb. Кроме того, система MnSb образует широкий ряд твердых растворов Mn_{1+x}Sb и их магнитные свойства существенно зависят от состава. Так, температура Кюри $Mn_{1+x}Sb$ уменьшается от 580 K до 510 K [19], а константа магнитной анизотропии первого порядка изменяет свой знак [20] при увеличении x от нуля до 0.1. На возможное изменение состава включений и самой пленки в сторону стехиометрического указывают приведенные выше результаты исследования КРС, что, в свою очередь, также может приводить к изменению величины К. Подобным образом, например, объясняется увеличение эффективного магнитного момента пленок GaMnSb после отжига [6].

Для ответа на вопрос о причинах и механизмах, приводящих к изменению температуры блокировки, были проведены исследования, позволяющие независимыми методами определить значения *K* до и после отжига.

Были измерены петли магнитного гистерезиса при различных температурах неотожженных (рис. 4a) и отожженных (рис. 4b) образцов. Полученные гистерезисные кривые типичны для ферромагнетиков: наблюдается насыщение в магнитных полях около 500 Э, форма петель близка к прямоугольной, коэрцитивная сила H_C сильно зависит от температуры T. Зависимость $H_C(T)$ для обеих групп образцов показана на рис. 5. С повышением температуры коэрцитивная сила уменьшается в неотожженном образце от 330 \ni при T = 2 K до нуля при T = 100 K, что согласуется с данными о температуре блокировки $T_B = 95$ К, полученными из температурной зависимости M(T). В отожженном образце H_C с повышением температуры уменьшается от 600 Э при T = 2 К до 260 Э при T = 300 К. Даже при комнатной температуре коэрцитивная сила в этой группе образцов не обращается в нуль, так как температура блокировки, как следует из M(T), заметно выше: $T_B = 390$ К. Ранее в статье [9] было показано, что зависимость $H_C(T)$ пленок GaMnSb описывается формулой Кнеллера [21]:



Рис. 4. Петли магнитного гистерезиса неотожженных (*a*) и отожженных (*б*) пленок GaMnSb при различных температурах

$$H_C = H_A \left(1 - \sqrt{\frac{T}{T_B}} \right), \tag{1}$$

где H_A — поле анизотропии (в некоторых статьях формулу (1) называют соотношением Нееля – Брауна). Формула Кнеллера справедлива для невзаимодействующих суперпарамагнитных наночастиц. На рис. 5 сплошными линиями показана аппроксимация зависимости $H_C(T)$ выражением (1). Для неотожженных образцов наблюдается расхождение поведения $H_C(T)$ с формулой (1). Среди возможных причин можно указать распределение наночастиц по размерам; диполь-дипольное взаимодействие между наночастицами; неупорядоченность поверхностных спинов, которые влияют на поверхностную анизотропию, и, следовательно, суммарную анизотропию наночастиц; разброс осей легкого намагничивания и т. д. Из аппроксимации зависимо-



Рис. 5. Температурные зависимости коэрцитивной силы неотожженных (1) и отожженных (2) пленок GaMnSb. Сплошными линиями показаны аппроксимации

сти $H_C(T)$ были определены температура блокировки нановключений T_B и поле магнитной анизотропии H_A . Для неотожженного образца $T_B = 95 \pm 16 \text{ K},$ $H_A = 330 \pm 30$ Э. Для отожженного образца $T_B =$ $= 430 \pm 40$ K, $H_A = 630 \pm 70$ Э. Таким образом, термообработка пленок GaMnSb приводит к заметному увеличению характеристик, определяющихся магнитной анизотропией. Физический смысл поля магнитной анизотропии состоит в том, что Н_А является мерой энергии магнитной анизотропии, выраженной в единицах напряженности магнитного поля. Зная значения поля магнитной анизотропии и намагниченности насыщения M_S, определенное из зависимостей магнитного момента от напряженности магнитного поля M(H) (рис. 4), можно оценить константу магнитной анизотропии согласно формуле $H_A = 2K/M_S$. При температуре T = 300 К в неотожженных образцах константа магнитной анизотропии $K = 0.9 \cdot 10^4$ эрг/см³, в отожженных образцах $K = 3.2 \cdot 10^4$ эрг/см³. Таким образом, термообработка пленок GaMnSb приводит к росту константы магнитной анизотропии К более чем в три раза. Отметим, что определенные здесь значения К при T = 300 K близки к значению $K = 1.3 \cdot 10^4 \text{ эрг/см}^3$, найденному ранее для монокристаллов MnSb с помощью ферромагнитного резонанса [22], и заметно ниже значения $K = 14 \cdot 10^4$ эрг/см³, найденному ранее в работе [6]. Завышенное значение, полученное в работе [6], вероятно, связано с тем, что для анализа ориентационной зависимости резонансного поля линии ферромагнитного резонанса использовались формулы Киттеля для сплошной намагничен-



Рис. 6. (В цвете онлайн) Светлопольное ПЭМ-изображение высокого разрешения неотожженной пленки GaMnSb (*a*). Желтым цветом выделен увеличенный участок, показанный на рис. б. Двумерный спектр Фурье от этой области (*в*) и расчетная электронограмма (*г*)

ной тонкой пленки, что не совсем отвечает гранулированной структуре образцов GaMnSb с включениями MnSb даже с учетом диполь-дипольного взаимодействия между ними. Ниже обсуждаются причины увеличения значения K в результате термообработки с позиций структурного фазового перехода в нановключениях MnSb.

Анализ структуры неотожженных пленок GaMnSb был проведен по светлопольным ПЭМ-изображениям высокого разрешения (рис. 6а) с последующим преобразованием Фурье отдельных зерен пленки. В используемой базе данных (Find It) найдено только одно тройное соединение Ga_{0.9}Mn_{0.1}Sb [23] с пространственной группой F-43m и параметром элементарной ячейки a = 0.610 нм. Это соединение не подходит по =стехиометрии, но тем не менее было проверено на совпадение со структурными характеристиками. Кроме того, в этой же базе данных и в ряде литературных источников проверены фазы MnSb и GaSb со стехиометрией близкой к 1:1. Как оказалось, кристаллическое соединение MnSb с такой стехиометрией — гексагональное с пространственной группой P6₃/mmc [24] и параметрами элементарной ячейки a = 0.413 нм, c = 0.578 нм. Соединение GaSb может принимать несколько полиморфных модификаций. Первая из них — кубическая (пр. гр.



Рис. 7. Светлопольное ПЭМ-изображение высокого разрешения участка отожженной пленки GaMnSb (*a*). Двумерный спектр Фурье от этой области (*б*) и расчетная электронограмма кубического соединения GaMnSb в проекции [101] (*в*)

F-43*m*) с параметром решетки, близким к тройному соединению, a = 0.6096 нм, [25]. Кроме того, рассматривались еще два соединения, обнаруженные под давлением, — гексагональный GaSb (пр. гр. P6₃/mmc) с параметрами элементарной ячейки a = 0.26981 нм, c = 0.24790 нм [26], и тетрагональный GaSb с пространственной группой I4₁/amd, постоянными элементарной ячейки a = 0.5348 нм и c = 0.2937 нм [27]. На рис. 6a видны отдельные зерна пленки GaMnSb, на которых наблюдалась периодичность кристаллической решетки в двух направлениях и без картин Муара, они и выбирались для анализа структуры. От этого и подобного участков проводился анализ Фурье, и двумерные спектры Фурье сравнивались с расчетными картинами электронной дифракции для описанных выше фаз. Пример такого сравнения представлен на рис. 66,г. Таким образом, большая часть спектров в неотожженном образце совпала с картинами электронной дифракции для гексагонального соединения с пространственной группой *P6*₃/*mmc*.

Для анализа кристаллической структуры отожженных пленок GaMnSb так же, как и в предыдущем случае, использовалось преобразование Фурье участков изображений с высоким разрешением (рис. 7*a*). Было проанализировано около десяти участков, пример приведен на рис. 7. В результате все исследованные участки однозначно указали на то, что структура пленки кубическая и соответствует структурному типу кристаллической решетки соединения GaSb (пр. гр. F-43m). Более того, на изображениях отчетливо видны двойники и дефекты упаковки, характерные для кубической структуры GaSb.

Таким образом, данные просвечивающей электронной микроскопии указывают на то, что изменение магнитной анизотропии пленок GaMnSb в результате термообработки может быть обусловлено

переходом кристаллической структуры магнитных нановключений MnSb из гексагональной (пр. гр. $P6_3/mmc$) в кубическую (пр. гр. *F*-43*m*). К сожалению, однозначно определить возможный рост или падение напряжений кристаллической решетки в гранулах, возникающие в результате фазового перехода, методами электронной микроскопии не представляется возможным из-за поликристаллического характера пленок. Прилегающие гранулы сопрягаются различными гранями, ориентационные соотношения между гранулами значительно различаются, причем границы раздела не плоские. Все это создает возможности снятия напряжений в виде дислокаций несоответствия различного типа или возникновения атомарных ступеней, также уменьшающих напряжение кристаллических решеток.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены исследования условий и механизмов контролируемого увеличения магнитной анизотропии посредством термообработки пленок GaMnSb, содержащих магнитные нановключения MnSb. Выполнены измерения температурных и полевых зависимостей магнитного момента двух групп образцов — неотожженных и подвергнутых отжигу. Температурные зависимости магнитного момента измерены в двух режимах — при охлаждении образца в нулевом магнитном поле и магнитном поле напряженностью 10 кЭ. Анализ полученных кривых позволил определить температуру блокировки нановключений MnSb пленок обеих групп. Полевые зависимости магнитного момента измерены в виде петель магнитного гистерезиса при различных температурах, что позволило построить температурную зависимость коэрцитивной силы нановключений MnSb пленок обеих групп. Показано, что температурная зависимость коэрцитивной силы описывается законом Кнеллера (Нееля – Брауна). Соответствующая аппроксимация позволила определить температуру блокировки и поле магнитной анизотропии нановключений MnSb пленок обеих групп.

Установлено, что термообработка пленок GaMnSb приводит к заметному увеличению характеристик, определяющихся магнитной анизотропией: температуры блокировки от 95 K до 390 K и поля магнитной анизотропии от 330 Э до 630 Э.

Данные просвечивающей электронной микроскопии указывают на то, что изменение магнитной анизотропии пленок GaMnSb в результате термообработки может быть обусловлено переходом кристаллической структуры магнитных нановключений MnSb из гексагональной (пр. гр. $P6_3/mmc$) в кубическую (пр. гр. F-43m).

А. И. Дмитриев признателен А. Д. Таланцеву за помощь в исследованиях на СКВИД-магнитометре. Работа выполнена по теме государственного задания 0089-2014-0027 с использованием оборудования Аналитического центра коллективного пользования ИПХФ РАН, а также при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (грант № 16.2814.2017/ПЧ) и РФФИ (гранты №№ 17-02-00262, 15-07-03580). В части осаждения тонких пленок GaMnSb работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках Государственного задания ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН (соглашение № 007-ГЗ/ЧЗ363/26).

ЛИТЕРАТУРА

- P. N. Hai, S. Ohya, M. Tanaka et al., Nature 458, 489 (2009).
- В. В. Рыльков, Б. А. Аронзон, Ю. А. Данилов и др., ЖЭТФ 127, 838 (2005).
- F. Matsukura, E. Abe, H. Ohno, J. Appl. Phys. 87, 6442 (2000).
- F. Matsukura, E. Abe, Y. Ohno et al., Appl. Surf. Sci. 159–160, 265 (2000).
- E. Abe, F. Matsukura, H. Yasuda et al., Physica E 7, 981 (2000).
- А. Д. Таланцев, О. В. Коплак, Р. Б. Моргунов, ФТТ 57, 307 (2015).

- О. В. Коплак, А. А. Поляков, А. Б. Давыдов и др., ЖЭТФ 147, 1170 (2015).
- A. I. Dmitriev, A. D. Talantsev, O. V. Koplak et al., J. Appl. Phys. 119, 073905 (2016).
- А. И. Дмитриев, А. А. Филатов, ФТТ 59, 1712 (2017).
- 10. С. Ф. Маренкин, О. А. Новодворский, А. В. Шорохова и др., Неорг. матер. 50, 973 (2014).
- A. A. Lotin, O. A. Novodvorsky, L. S. Parshina et al., Appl. Phys. B 104, 565 (2011).
- 12. M. Cardona and G. Untherodt, *Light Scattering in Solids*, Springer-Verlag, Berlin (1983), p. 96.
- 13. G. Yang, F. Zhu, and S. Dong, J. Cryst. Growth. 316, 145 (2011).
- 14. J. E. Maslar, W. S. Hurst, and C. A. Wang, J. Appl. Phys. 103, 013502 (2008).
- M. R. Islam, N. F. Chen, and M. Yamada, Cryst. Res. Technol. 43, 1091 (2008).
- Ю. А. Данилов, Б. Н. Звонков, А. В. Кудрин и др., Изв. РАН, сер. физ. 76, 199 (2012).
- 17. S. G. Kim, H. Asahi, M. Seta et al., J. Appl. Phys. 74, 579 (1993).
- S. Winnerl, S. Sinning, T. Dekorsy et al., Appl. Phys. Lett. 85, 3092 (2004).
- V. Seshi Bai and K. V. S. Rama Rao, J. Appl. Phys. 55, 2167 (1984).
- 20. T. Okita and Y. Makino, J. Phys. Soc. Jpn. 25, 120 (1968).
- 21. E. F. Kneller and F. E. Luborsky, J. Appl. Phys. 34, 656 (1963).
- 22. G. Markandeyulu and K. V. S. Rama Rao, J. Magn. Magn. Mater. 67, 215 (1987).
- 23. S. Basu and T. Adhikari, J. Alloys Comp. 205, 81 (1994).
- 24. H. Nagasaki, I. Wakabayashi, and S. Minomura, J. Phys. Chem. Sol. 30, 329 (1969).
- 25. Н. А. Горюнова, Н. Н. Федорова, ЖТФ 25, 1339 (1955).
- 26. S. T. Weir, Y. K. Vohra, and A. L. Ruoff, Phys. Rev. B 36, 4543 (1987).
- 27. J. C. Jamieson, Science 139, 845 (1963).